

DIN 50450-2:2026-03 (D)

Prüfung von Materialien für die Halbleitertechnologie - Bestimmung von Verunreinigungen in Träger- und Dotiergasen - Teil 2: Bestimmung der Sauerstoffverunreinigung in Stickstoff, Argon, Helium, Neon und Wasserstoff mittels einer galvanischen Messzelle

Inhalt	Seite
Vorwort	3
1 Anwendungsbereich.....	4
2 Normative Verweisungen	4
3 Begriffe	4
4 Einheiten	4
5 Kurzbeschreibung des Verfahrens	4
6 Prüfeinrichtung.....	4
7 Betriebs- und Kalibriergase, Chemikalien.....	5
8 Vorbereitung.....	5
8.1 Probenvorbereitung.....	5
8.2 Messvorbereitung	5
8.2.1 Einstellen des Nullpunktes.....	5
8.2.2 Einstellen des Kalibrierpunktes.....	5
9 Durchführung	5
10 Auswertung und Messunsicherheit.....	6
11 Prüfbericht	6
Anhang A (informativ) Beispiele zur Berechnung der Messunsicherheit	7
A.1 Berechnung der Messunsicherheit auf Basis einer Zweipunktkalibrierung.....	7
Literaturhinweise	9
Tabellen	
Tabelle A.1 — Daten zur Berechnung des Messergebnisses	7
Tabelle A.2 — Messergebnis und Standardunsicherheiten	8